

Title (en)

Device for introducing a gas into and dispensing it from a container.

Title (de)

Einrichtung zum Einbringen eines Gases in ein Behältnis und zum Entnehmen aus diesem.

Title (fr)

Dispositif d'introduction d'un gaz dans un récipient et de distribution de celui-ci à partir de ce récipient.

Publication

**EP 0393388 A1 19901024 (DE)**

Application

**EP 90105785 A 19900327**

Priority

DE 3910813 A 19890404

Abstract (en)

A device for introducing a gas or gas mixture under pressure into a container (1) and for dispensing at least a portion of the gas or gas mixture contained in the container (1) from the same has a feed line (7) which contains at least one valve (9) and via which a connection can be made between a gas reservoir (4) and a connection (2) of the container (1). A discharge line (10) which can likewise be connected to the container (1) contains at least one valve (13). The feed line (7) is connected to a booster device (15, 15') and the discharge line (10) is connected to a storage device (15). <IMAGE>

Abstract (de)

Eine Einrichtung zum Einbringen eines unter Druck stehenden Gases oder Gasgemisches in ein Behältnis (1) und zum Entnehmen wenigstens eines Teils des im Behältnis (1) enthaltenen Gases oder Gasgemisches aus dem Behältnis (1) weist eine wenigstens ein Ventil (9) enthaltende Zuführleitung (7) auf, über die eine Verbindung zwischen einem Gasspeicher (4) und einem Anschluß (2) des Behältnisses (1) herstellbar ist. Eine ebenfalls an das Behältnis (1) anschließbare Abaßleitung (10) enthält wenigstens ein Ventil (13). Die Zuführleitung (7) ist an eine Druckerhöhungsvorrichtung (15, 15') und die Abaßleitung (10) an eine Speichereinrichtung (15) angeschlossen sind.

IPC 1-7

**F17C 5/06**; **F17C 7/00**

IPC 8 full level

**F17C 5/06** (2006.01); **F17C 7/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

**F17C 5/06** (2013.01); **F17C 7/00** (2013.01); **F17C 2205/0323** (2013.01); **F17C 2205/0326** (2013.01); **F17C 2221/03** (2013.01); **F17C 2223/0123** (2013.01); **F17C 2227/0135** (2013.01); **F17C 2227/04** (2013.01)

Citation (search report)

- [A] DE 1136356 B 19620913 - TEVES KG ALFRED
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 6, Nr. 193 (M-160)[1071], 2. Oktober 1982; & JP-A-57 101 199 (HITACHI SEISAKUSHO K.K.) 23-06-198

Cited by

CN106287226A; EP0717699A4

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0393388 A1 19901024**; DE 3910813 A1 19901011

DOCDB simple family (application)

**EP 90105785 A 19900327**; DE 3910813 A 19890404